

Laboratory X-ray Photoelectron Spectroscopy System

**PHI 5000 VersaProbe II**

Scanning XPS Microprobe™

选配件

**禹重科技® ÜZONGLAB**

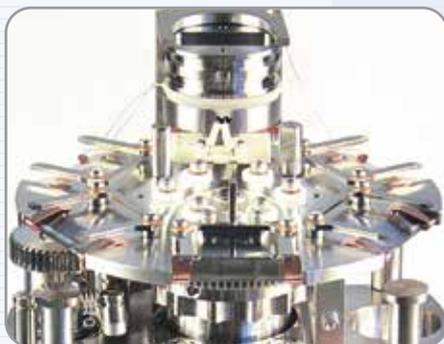
成分分析仪器 | 表面测试仪器 | 样品前处理仪器

多功能前处理选配件

# ***VersaPrep / VersaLock***

*Versatile Preparation Chamber / Versatile Loadlock Chamber*

扩展端口用前处理室 / 快速进样室用处理室



另一个在科研分析时使用PHI 5000 Versaprobe II 的原因

**アルバック・ファイ株式会社**

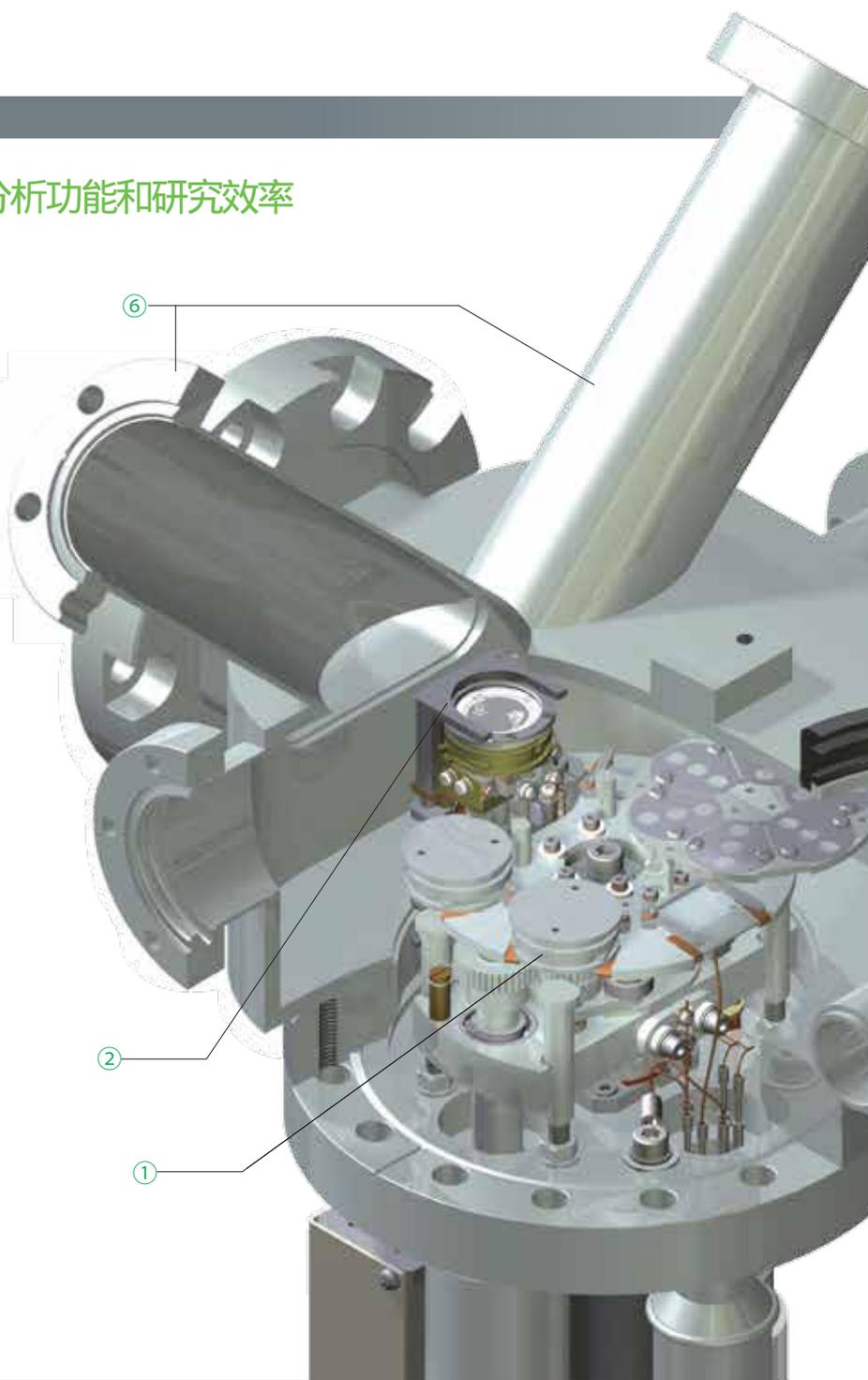
## PHI 5000 VersaProbe II 提高分析功能和研究效率 提供多种选配件套件。

### ① 样品泊放机构

前处理室内的样品泊放机构，最多可以放置5个25mm的样品托盘，或放置2个60mm的样品托盘，因此，可以在真空中暂时保存多个样品。

### ② 加热冷却机构

在样品托的泊放机构中可以追加加热和冷却选配件，加热时，有带有嵌入加热器的专用25mm样品托，可以加热到800°C，冷却时用液氮可以冷却到-150°C，在样品台冷却初期，在15分钟内可迅速冷却到-100°C。

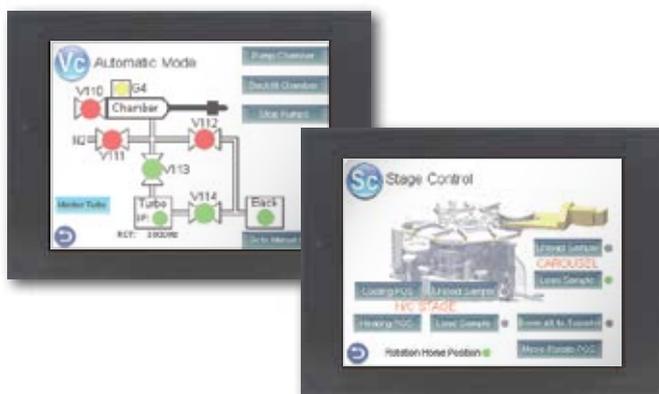


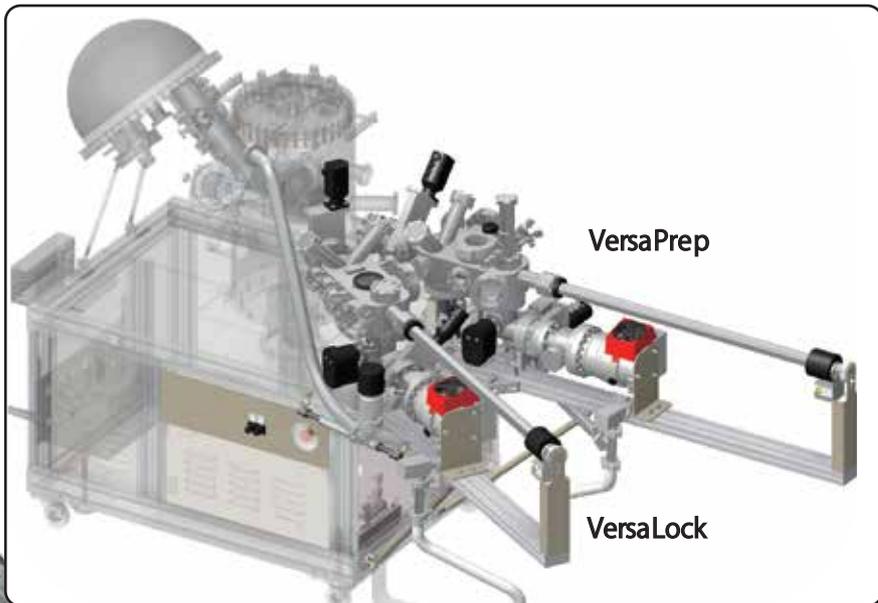
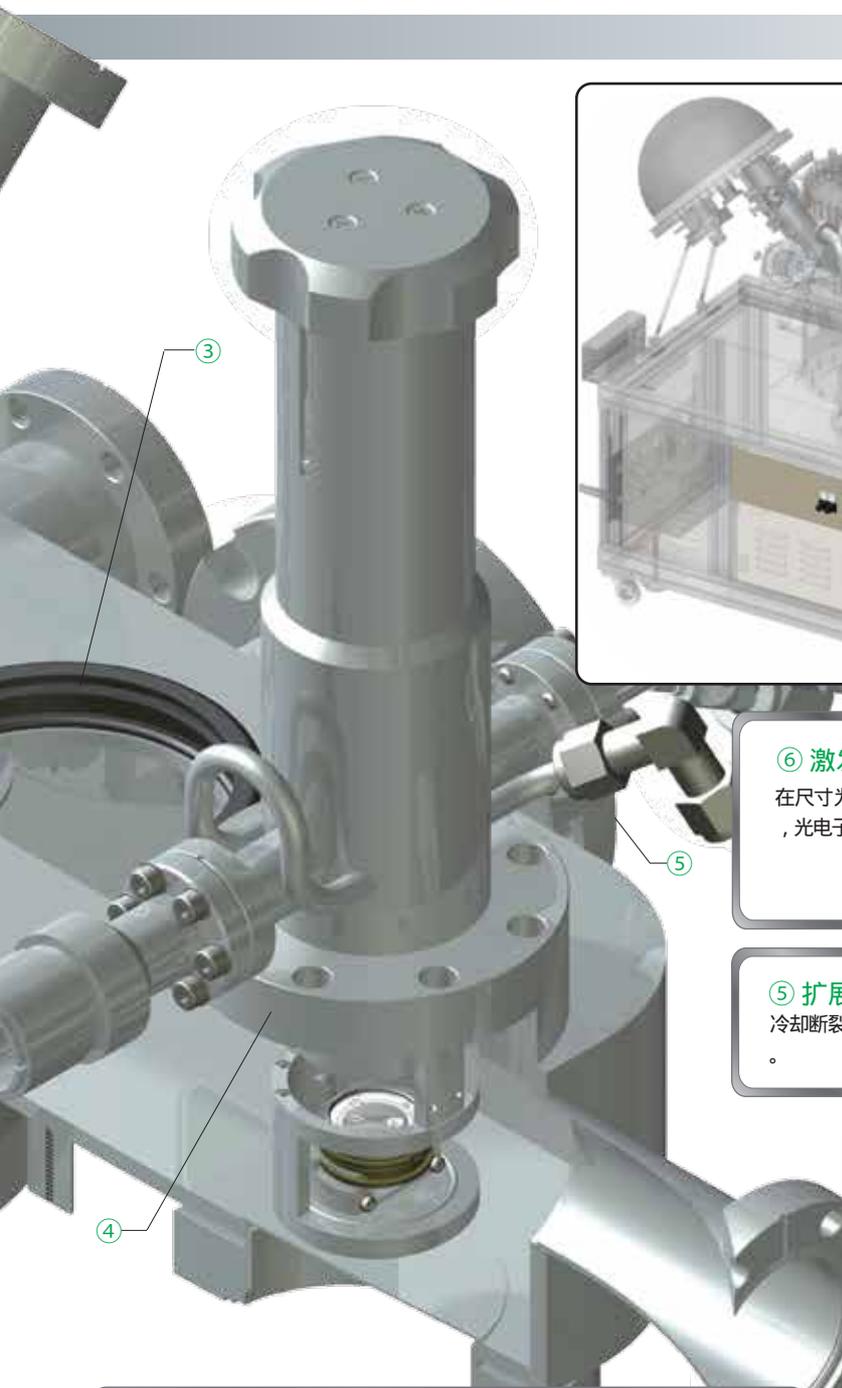
### 触摸屏控制器

排气系统控制<sup>※1</sup>、样品交接的泊放(①)和加热冷却机构(②)加热冷却机构(②)和气体反应管(④)的专用加热控制器。采用触摸屏操作加热冷却机构(②)和气体反应管(④)用一个加热电源切换实现，使用专用的25mm样品托盘，内部嵌入热电偶，可以调节加热和冷却的温度。包括排气系统在内，全部附属操作均采用直观的图像和触摸的方式，实现简单的操控。

※1 VersaProbe II 的扩展端口安装情形。

另外，VersaProbe II 的预处理安装情形，采用本体的软件进行控制。





⑥ 激发源 / 检测器起用端口

在尺寸为ICF070扩展接口上以45度方向, 可以安装电子枪、离子枪等激励源, 光电子倍增管等检测器, 样品。也可以安装逆光电子能谱 (IPES) 装置。

⑤ 扩展服务端口

冷却断裂, 以及红外加热反应炉等, 可以按照用户需求安装在扩展服务端口。

④ 气体反应管

高温高压反应装置选配件, 使用专用25mm样品托盘, 在气体流通时可以加热到500°C, 而气体在密封状态时, 可以加热到800°C, 对应最大的气体压力可以达到2个大气压。反应气路由US316, 石英和蓝宝石构成, 该装置可以将气体密闭在其中。因而, 反应气体可以在无泄漏的条件下引入反应室。

③ 传送管

与VersaLock匹配

为防止样品送入分析仪器过程中暴露大气的选配件, 该传送管可以使用25mm样品托盘或60mm样品托盘。总之, 可以用于分析二次电池等样品。



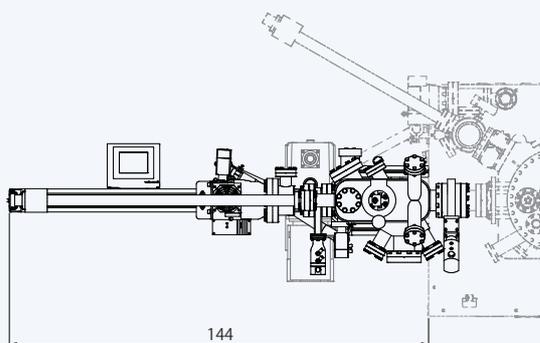
25mm



60mm

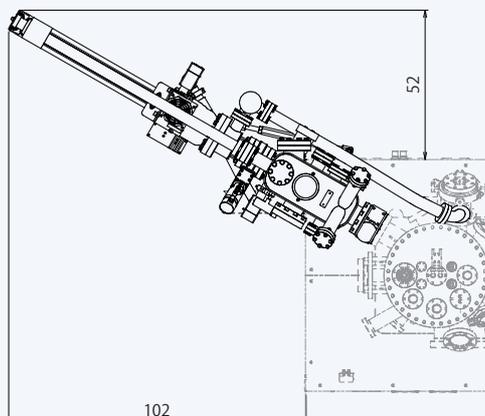


# VersaPrep



# VersaLock

单位：cm



规格概要		VersaPrep : 扩展端口用前处理室		VersaLock : 快速进样室用前处理室 <sup>※1</sup>
		分子泵规格	离子泵规格	
排气系统	室体材质	SUS304		
	扩展服务端口	ICF117 × 1 ICF070 × 2		ICF117 × 1 ICF070 × 1
	激发源 / 检测器起用端口	ICF070 × 2 (上面45度配置)		ICF070 × 2 (上面45度配置)
	主排气泵	分子泵	离子泵	分子泵
	预排气	机械泵	※2	机械泵
	极限真空	5.0 × 10 <sup>-6</sup> Pa <sup>※3</sup>	5.0 × 10 <sup>-6</sup> Pa <sup>※3</sup>	5.0 × 10 <sup>-4</sup> Pa
	控制阀门	压缩空气 <sup>4</sup>		压缩空气 <sup>※5</sup>
	真空计测量范围	5.0 × 10 <sup>-8</sup> ~ 6.6 × 10 <sup>-1</sup> Pa		
样品传送	方式	磁耦合		
泊放机构	上下驱动	压缩空气		
	转动驱动	手动		
	样品托盘放置个数	25mm样品托5个		25mm样品托5个或 60mm样品托2个
加热冷却机构	样品托盘	专用25mm样品托		
	加热温度	800°C (冷却位置为400°C)		
	加热方式	样品托内置加热器		
	冷却温度	-150°C (真空中快速冷却模式-100°C/15分)		
	冷却方式	冷却介质 (液氮)		
气体反应管	加热托盘	专用25mm样品托		
	加热温度	800°C (密闭气体)、500°C (流动气体)		
	加热方式	样品托内置加热器		
	最大压力	2个大气压		
	气体导入口	1/4 VCR 接口		
快速进样室相机		○	○	○
传送管	25 mm	×	×	○
	60 mm	×	×	○
控制器	加热电源最大输出	36V 9.5A		
	温度调节方式	PID		
	输入电源	200~230V 15A 50/60Hz		

- ※1 VersaProbe II的扩展端口可以用来安装VersaLock。  
 ※2 预排气经由XPS主机的快速进样室进行。  
 ※3 烘烤后达到真空度。  
 ※4 压缩空气从XPS主机上分流导入。并且，控制阀由触摸屏操控。  
 ※5 控制阀由XPS上主机的控制软件操控。

## 禹重科技® UZONGLAB

成分分析仪器 | 表面测试仪器 | 样品前处理仪器

上海市闵行区春申路2525号芭洛商务大楼  
 电话：021-8039 4499 传真：021-5433 0867  
 上海|北京|沈阳|太原|长沙|广州|成都|香港  
 全国销售和售后服务电话：400-808-4598

邮编：201104, China  
 邮箱：shanghai@uzong.cn

更多信息请访问：www.uzong.cn



了解我们



微信公众号